

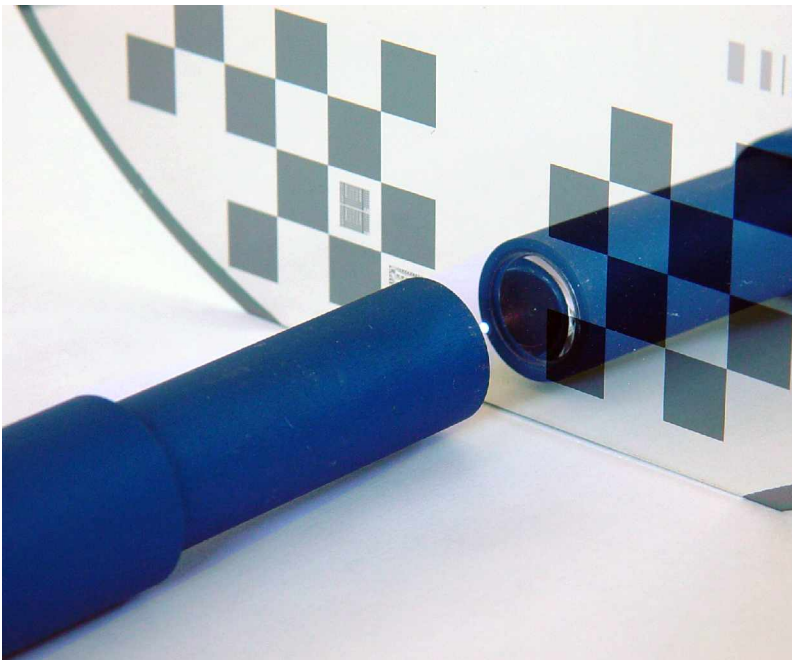
Einfache und berührungslose Dickenmessung jetzt auch von SiC-Wafern

Neues chromatisches Messsystem Nemesis WT

Deutliche Rationalisierungsmöglichkeiten bei der Fertigung dünnschichtiger Materialien wie SiC-Wafer und scheibenartiger Messproben bietet jetzt das neue Messsystem Nemesis XV von Precitec Optronik in Rodgau.

Das System zur Dicken- und Topografieerkennung von transparenten und auch **nichttransparenten** Stoffen ist in der Lage, berührungslos und damit beschädigungsfrei, zeitgleich die Dicke und Rauheitswerte des hochsensiblen Produktes exakt zu messen.

Ergebnis: Die gewünschte Produkt-Qualität wird zuverlässig gesichert.



Die Messgenauigkeit ist besser als 1µm. Sie liefert damit eine sichere Grundlage für den Offline-Einsatz im Rahmen der Stichprobenmessung.

Das neue System arbeitet mit den chromatischen Weißlichtsensoren der neuen Produktfamilie CHRcodile von Precitec Optronik.

Nemesis WT beinhaltet eine automatische Datenauswertung. Die Messwerte stehen dem Anwender ebenfalls als Ascii-Daten zur Verfügung. Auch die Excel- Dokumentation und Verarbeitung über PC ist somit problemlos möglich.

Zusammengefasst bietet das ab Herbst 2005 lieferbare Messsystem Nemesis WT erhebliche Vorteile für die Fertigung:

- Ø Zuverlässige Produktkontrolle von Materialdicke und Topografie
- Ø Optimierung des Produktionsprozesses
- Ø Sicherung der Produktqualität
- Ø Vermeidung von Nacharbeit